

1. The present invention of this application relates to "a substrate testing device and a substrate testing method", and claims 1 to 5 setting forth a testing unit scanning by electronic beams, mark detecting unit, position calculating unit, aligning unit, steps thereof, a substrate position allocating or aligning, correspond to the cited invention 1 (Korean Patent Laid Open Publication No.2002-54170: 2002.7.6) in the technical ideas of the relative structures and means with moving of testing position, sensing of alignment mark, controlling of the sensed condition and converting into an auto-focus mode, alignment of optimum focus, aligning a second alignment mark and a first alignment mark in optimum positions, substrate testing, microscope, control part, moving stage, drive gear or alignment marks, and the cited invention 2 (JP-A-12-9661: 2000.1.14) in the technical ideas of the relative structures and means using an XYZ moving table, detecting camera, positioning pin, slide, stage, defect detecting portion, defect reviewing portion, holding mechanism or control means, and the cited invention 3 (Korean Patent Laid Open Publication No.2001-29226: 2001.4.6) in the technical ideas of the relative structures and means with a camera, monitor, computer, inputting the transmitted image pictures scanned by the camera into the computer,

recognizing an aligning reference line of a reference alignment mark, confirming the aligned conditions, and confirming errors, thereby to test the alignments. It is possible to easily invent these technical ideas of the relative structures and means without any constituent difficulty through the simple combination, simple addition, simple alternation and selection at such a level of persons who have common knowledge (called as "those skilled" hereafter) in the technical field to which the inventions pertain. The electronic beam scanning is relevant to the commonly known means in this technical field.

Small or fine differences in the constitutions, descriptions or expressions may be easily solved without any constituent difficulty through the simple combination, simple addition, simple alternation and selection at the level of those skilled. In the light of the technical ideas of the cited inventions and the concerned technical fields, to detect the substrate position as the object and effect of this invention cannot be regarded as having any peculiarity in the object or any prominence of the effect, and it can be easily solved at the level of those skilled through the cited inventions and the technical fields (Clause 2 of Article 29 of the Patent Law).

발송번호: 9-5-2006-010752344
발송일자: 2006.02.24
제출기일: 2006.04.24

수신 서울특별시 강남구 역삼동 823-1 풍림빌딩
8층(특허법인 원전)
특허법인 원전[특허법인 원전 임석재]
135-784

특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 명 칭 가부시키가이샤 시마즈세이사쿠쇼 (출원인코드: 520000367629)
주 소 일본 교토후 교토시 나카교쿠 니시노교쿠와바라초 1반찌
대 리 인 명 칭 특허법인 원전
주 소 서울특별시 강남구 역삼동 823-1 풍림빌딩 8층(특허법인 원전)
지정된변리사 특허법인 원전 임석재 외 1명

출 원 번 호 10-2004-0027002
발 명 의 명 칭 기관 검사장치 및 기관 검사방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제6항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.
2. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1. 본원 발명은 “기관 검사장치 및 기관 검사방법”에 대한 것으로서, 청구항 제1항 내지 제6항에 기재한 전자빔으로 스캐닝하는 검사유닛, 마크 검출 유닛, 위치계산 유닛, 얼라이닝 유닛, 이들 단계, 기관위치 할당 또는 얼라이닝 등은 인용발명1(한국공개특허공보2002-54170: 2002.7.6)의 검사위치 이동, 얼라인마크 감지, 감지된 상태 제어하여 오토포커싱모드 전환, 최적 포커스 정렬, 둘째 얼라인 마크와 첫째 얼라인 마크 최적위치 정렬, 기관 검사, 현미경, 제어부, 이동 스테이지, 구동기어, 얼라인마크 등 관련 구성과 수단의 기술사상, 인용발명2(일본공개특허공보평12-9661:2000.1.14)의 XYZ 이동테이블, 검출 카메라, 위치 결정핀, 슬라이드, 스테이지, 결함 검출부, 결함 리뷰부, 파지기구, 제어수단 등을 이용한 관련 구성과 수단위 기술사상, 인용발명3(공개특허공보2001-29226:2001.4.6)의 카메라, 모니터, 컴퓨터, 카메라로 스캐닝된 전송영상을 컴퓨터로 입력, 기준얼라인 마크의 정렬 기준선 인식, 정렬 상태 확인수단과 확인 등을 하여 얼라인머트를 검사하는 관련 구성과 수단의 기술사상, 그리고 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 “당업자”라 함)의 수준에서 단순조합, 단순부가, 단순변경 및 선택 등을 통하여 구성의 곤란성 없이 용

이하에 발명할수 있으며, 전자빔 스캐닝은 해당기술분야에서 주지관용수단에 해당되며, 기타 구성상의 미소한 차이나, 기재상 또는 표현상의 미소한 차이는 인용발명과 해당기술분야의 기술사상으로부터 단순조합, 단순부가, 단순변경 및 선택 등을 통하여 당업자 수준에서 구성의 곤란성 없이 용이하게 해소할수 있고, 본원 발명의 목적과 효과인 기판위치의 검출은 인용발명과 해당기술분야의 기술사상에 비추어 볼때, 목적의 특이성이나 효과의 현저성이 있는 것으로 볼수 없으며, 당업자 수준에서 인용발명과 해당기술분야의 기술사상으로부터 용이하게 해소할수 있습니다.(특허법 제29조 제2항)

2. 청구항 제5항은 종속항으로서, 인용되는 항의 어떤 구성을 한정하는지 지시하고자 하는 대상 구성이 명확하지가 않습니다.(특허법 제42조제4항제2호)

[첨 부]

첨부1 공개특허 제2002-54170호(2002.07.06) 1부.

첨부2 일본공개특허공보 평12-009661호(2000.01.14) 1부.

첨부3 공개특허 제2001-29226호(2001.04.06) 1부. 끝.

특허청

2006.02.24
전기전자심사본부
영상기기심사팀

심사관

정성태



<< 안내 >>

명세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허법·실용신안법·디자인보호법및상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

기타 문의사항이 있으시면 ☎042)481-5763로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터(☎1544-8080)로 문의하시기 바랍니다.